

顕微鏡試料研磨機

本装置は、機械金属製品開発支援機器整備事業として、平成19年度に「電源立地地域対策交付金」により整備したものです。

顕微鏡試料埋込機で成形した観察用試料を、表面ダレすることなく精密に自動で研磨を行います。



仕様

メーカー名	: ビューラー
型式	: フェニックスベータ/ベクトル
研磨盤回転数	: 30~600rpm
研磨盤	: 8インチ
研磨圧力(個別)	: 0~ 75N
(全体)	: 20~300N
研磨能力(個別)	: 1個~4個
(全体)	: 3個